

Etude du problème inverse en scatterométrie: Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

La scatterométrie est une méthode de mesure non destructive basée sur la mesure et l'interprétation des phénomènes de diffraction des structures périodiques. Le traitement des données et l'extraction des paramètres géométriques des structures étudiées constituent le problème inverse à résoudre. L'utilisation d'algorithmes de minimisation locale permet d'effectuer l'ajustement des données expérimentales sous certaines hypothèses statistiques. L'ensemble des études théoriques et expérimentales a mis en évidence que la scatterométrie permet de mesurer les profils de réseaux mono- et bi-périodiques compatibles avec les spécifications des futures circuits intégrés. Néanmoins, seuls certains paramètres géométriques de la structure diffractantes sont susceptibles d'être mesurés dans des conditions expérimentales standard. Cette méthode de mesure apparaît aussi être robuste vis-à-vis des défauts et des inhomogénéités du réseau et est bien corréléé avec les méthodes de mesure couramment utilisées dans en microélectronique (MEB, AFM). On peut noter que la précision des indices optiques des matériaux constitue l'une des clés de la fiabilité de la mesure.

Etude du problème inverse en scatterométrie : Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique. Richard.

Méthodes et Applications. Mechanical engineering . Bookcover of Etude du problème inverse en scatterométrie. Omni badge . Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique. Physics.

1993. [QUI05] Quintanilha R., "Etude du problème inverse en diffractométrie spectroscopique, application à la métrologie dimensionnelle en microélectronique",.

for Voltage Tunable Applications. VDM Verlag Dr. Müller . Capa do livro de Etude du problème inverse en scatterométrie. Omni badge . Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique.

24 oct. 2011 . Les besoins de la métrologie en microélectronique 4.4.4 Etude comparative de la goniométrie et de ... La résolution du problème inverse consiste à retrouver par l' ... Le mot scattérométrie vient de l'association du mot anglais .. spectroscopique pour la caractérisation de réseau, permet de contrôler.

11 4 Table des matières I.3 Problème inverse en ellipsométrie I.3.1 Position du . réseau de neurones III.2.1 Problème inverse en scatterométrie III.2.2 Etude d un . θC et θA I.5

Représentation schématique de l ellipsomètre spectroscopique à ... application qui peut être exploitable en métrologie, à savoir la classification.

utilisée comme outil de métrologie dimensionnelle. Puis, la fabrication . lithographie/gravure standard utilisées en microélectronique. . Principe de la scatterométrie : à partir de la signature optique diffractée par une structure . d'un problème inverse .. for the metrology of sub $0.1\mu\text{m}$ linewidth structures », App. Opt., vol.

Etude du problème inverse en scatterométrie: Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique (Omn.Univ.

L'étude de l'évolution de l'indice optique pendant un changement de phase de second ..

Métrologie des dimensions critiques : scatterométrie et développements avancés . Metrology equipments introduced in this thesis highlight the application of .. variables dans le modèle utilisé pour la résolution du problème inverse.

22 sept. 2009 . Application `a la microélectronique. . La métrologie in situ et le contrôle de procédés en temps réel sont . Mots clés : scatterométrie, probl`eme inverse dynamique, temps réel, . Keywords : scatterometry, dynamic inverse problem, real time, .. L'ellipsom`etre spectroscopique `a modulation de phase.

Buy Etude du problème inverse en scatterométrie: Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique.

16 juin 2006 . Métrologie de l'endommagement multi-échelles . . Etude de l'endommagement laser dans les couches minces optiques . Scatterometry ou applications de l'ellipsométrie pour la ... Spectroscopie de corrélation spatiale de fluorescence et .. de l'objet à partir du champ

diffraité (problème inverse) et des.

5 Conclusion Chapitre 3 : Applications de l'ellipsométrie et de la scatterométrie ... La scatterométrie est une technique optique non destructive qui permet d'extraire les ... Après étude des données spectroscopiques obtenues durant le procédé de fabrication, ... La résolution d'un problème inverse permet de définir 39.

Etude Du Problème Inverse En Scatterométrie: Application De La Scatterométrie Spectroscopique À La Métrologie Dimensionnelle En Microélectronique (fre.

App, M. Opt, A. Martin, O. Bazin, C. Chaix-pluchery et al., Mechanisms . Contribution des réseaux de neurones dans le domaine de l'ellipsométrie : Application à la scatterométrie Really . Etude du problème inverse en diffractométrie spectroscopique: application à la métrologie dimensionnelle en microélectronique, Proc.

Etude du problème inverse en scatterométrie: Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique (Omn.Univ.

DEMONI - Etude du dépliement et du repliement d'acides nucléiques au moyen . les nano structures silicium : application au laser Raman silicium . PROSPIQ - Logiciel d'optimisation robuste et rapide pour la scatterométrie d'objets . QUANTADN - Développement d'un outil de métrologie optique (scatterométrie) pour.

Etude Du Problème Inverse En Scatterométrie. Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique.

29 mai 2015 . Micro et nanotechnologies/Microélectronique. . permettant de réaliser les études de dégazage des résines et de .. Spectroscopic Ellipsometry .. métrologie appropriés. .. de la lithographie EUV ont noté des problèmes similaires liés .. "Développement des techniques de scatterométrie en temps.

14 févr. 2012 . Préparée au Laboratoire des Technologies de la Microélectronique . I.1 Les outils de métrologie optique utilisés en scatterométrie . . I.1.1 Ellipsométrie spectroscopique. .. I.4 Résolution du problème inverse en temps réel . .. III.3 Application de la scatterométrie en temps réel pour le suivi de procédé de.

Etude du problème inverse en scatterométrie (Physik). Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique.

Application au procédé de nettoyage post-CMP en microélectronique . Обложка Etude du problème inverse en scatterométrie . Application de la scatterométrie spectroscopique à la métrologie dimensionnelle en microélectronique. Физика.

